



# 检 测 报 告

## TEST REPORT

检测编号: KDHJ259387

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	无锡华润上华科技有限公司

江苏康达检测技术股份有限公司  
KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.

# 声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	无锡华润上华科技有限公司		
通讯地址	江苏省无锡市新吴区锡士路		
联系人	褚亚男	联系电话	18800574369
采样日期	2025-08-04~2025-08-06	分析日期	2025-08-04~2025-08-08
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结论	检测结果见表1。		
<div>编制：丁玉清</div> <div>审核：封岳</div> <div>签发：邵娇娇</div> <div>检测机构检验章</div> <div>签发日期：2025 年 08 月 14 日</div> <div></div>			

表 1-1 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.7	22.7	22.6	22.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		33625	32066	34700	33464	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.54	0.81	0.72	0.69	5.0
	排放速率（kg/h）	0.023				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.36	1.00	0.57	0.64	10
	排放速率（kg/h）	0.021				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.6	22.5	22.2	22.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		31042	32342	32140	31841	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-3 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.7	22.6	22.2	22.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		33625	34700	32140	33488	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-4 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-026 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.9	23.8	23.8	23.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		29868	29429	30540	29946	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	0.36	0.50	0.40	0.42	5.0
	排放速率（kg/h）	0.013				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-5 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-026 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.7	23.8	23.7	23.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		28575	29494	29207	29092	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.58	0.43	0.67	0.56	10
	排放速率（kg/h）	0.016				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					



表 1-6 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-026 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.9	23.8	23.7	23.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		29868	30540	29207	29872	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-7 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		24.2	24.1	23.8	24.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		27318	29869	29957	29048	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	0.27	0.29	ND	0.22	5.0
	排放速率（kg/h）	6.4×10 <sup>-3</sup>				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	0.66	0.61	1.11	0.79	10
	排放速率（kg/h）	0.023				/
氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-8 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.7	23.5	23.3	23.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		29215	30619	29825	29886	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-9 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		24.2	23.8	23.3	23.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		27318	29957	29825	29033	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-10 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.8	22.5	22.4	22.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		26384	28701	27013	27366	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.52	ND	0.35	0.32	5.0
	排放速率（kg/h）	8.8×10 <sup>-3</sup>				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-11 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.2	22.2	22.4	22.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		28242	29712	29829	29261	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	5.12	1.33	3.06	3.17	10
	排放速率（kg/h）	0.093				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-12 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.8	22.4	22.4	22.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		26384	27013	29829	27742	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-13 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		26.1	25.6	25.1	25.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		41182	42325	43289	42265	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	0.32	0.23	ND	0.22	5.0
	排放速率（kg/h）	9.3×10 <sup>-3</sup>				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	0.92	1.36	1.07	1.12	10
	排放速率（kg/h）	0.047				/
氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					



表 1-14 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		25.8	24.9	25.3	25.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		43785	44334	44489	44203	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-15 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		26.1	25.1	25.3	25.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		41182	43289	44489	42987	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-16 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.5	24.1	23.9	23.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		27971	27455	27925	27784	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.34	0.42	0.40	0.39	5.0
	排放速率（kg/h）	0.011				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-17 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		24.3	24.9	25.6	24.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		28967	26394	26762	27374	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.77	0.78	1.62	1.06	10
	排放速率（kg/h）	0.029				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-18 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.5	23.9	25.6	24.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		27971	27925	26762	27553	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-19 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		25.7	26.0	26.4	26.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		41021	42319	43270	42203	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	0.51	0.32	0.32	0.38	5.0
	排放速率（kg/h）	0.016				/
氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-20 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		26.8	25.2	24.6	25.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		43395	43382	44081	43619	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.43	1.83	1.90	1.39	10
	排放速率（kg/h）	0.061				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-21 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		25.7	26.4	24.6	25.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		41021	43270	44081	42791	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					



表 1-22 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		26.1	25.7	26.3	26.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		39969	40660	41161	40597	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.33	0.21	0.55	0.36	5.0
	排放速率（kg/h）	0.015				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	1.97	0.72	1.84	1.51	10
	排放速率（kg/h）	0.061				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-23 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		25.6	24.9	24.4	25.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		39664	41206	42166	41012	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-24 固定污染源废气检测结果表（8 月 4 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		26.1	26.3	24.4	25.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		39969	41161	42166	41099	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-25 固定污染源废气检测结果表（8 月 5 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.1	21.8	21.9	21.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		27220	29519	27115	27951	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.35	0.33	0.87	0.52	5.0
	排放速率（kg/h）	0.015				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.49	0.56	0.61	0.55	10
	排放速率（kg/h）	0.015				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-26 固定污染源废气检测结果表（8 月 5 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.3	21.6	21.9	21.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		30119	28406	29501	29342	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-27 固定污染源废气检测结果表（8 月 5 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.1	21.9	21.9	22.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		27220	27115	29501	27945	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-28 固定污染源废气检测结果表（8 月 5 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.1	23.7	23.9	23.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		30023	31388	32105	31172	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.45	0.22	0.25	0.31	5.0
	排放速率（kg/h）	9.7×10 <sup>-3</sup>				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.37	0.59	0.32	0.43	10
	排放速率（kg/h）	0.013				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-29 固定污染源废气检测结果表（8 月 5 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.3	22.9	23.5	23.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		32086	31833	33103	32341	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					



表 1-30 固定污染源废气检测结果表（8 月 5 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.1	23.9	23.5	23.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		30023	32105	33103	31744	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-31 固定污染源废气检测结果表（8 月 5 日）

点位名称		FQ-021 废气排气筒		排气筒高度（m）		25
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		33.1	33.2	33.4	33.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		7683	7680	7671	7678	/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	1.52	0.61	0.51	0.88	10
	排放速率（kg/h）	6.8×10 <sup>-3</sup>				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-32 固定污染源废气检测结果表（8 月 5 日）

点位名称		FQ-016 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.9	22.5	22.4	22.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		19360	19378	19370	19369	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	0.66	ND	0.30	10
	排放速率（kg/h）	5.8×10 <sup>-3</sup>				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-33 固定污染源废气检测结果表（8 月 5 日）

点位名称		FQ-017 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.0	22.7	22.8	22.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		17573	17068	17050	17230	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-34 固定污染源废气检测结果表（8 月 6 日）

点位名称		FQ-051 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		活性炭吸附				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		31.2	31.1	31.3	31.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		2639	2590	2696	2642	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-35 固定污染源废气检测结果表（8 月 6 日）

点位名称		FQ-051 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		活性炭吸附				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	最大值	排放限值
烟气温度（℃）		31.2	31.4	31.6	/	/
标态烟气量（Nm³/h）		2639	2654	2732	/	/
硫化氢	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
	排放量（kg/h）	/	/	/	/	1.8
臭气浓度	无量纲	26	35	30	35	15000
备注	1、排放限值：《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 限值。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-36 固定污染源废气检测结果表（8 月 6 日）

点位名称		FQ-050 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		30.3	30.2	30.3	30.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		1334	1460	1408	1401	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-37 固定污染源废气检测结果表（8 月 6 日）

点位名称		FQ-049 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		30.7	30.7	30.6	30.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		2168	2100	1962	2077	/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	3.60	3.36	2.59	3.18	10
	排放速率（kg/h）	6.6×10 <sup>-3</sup>				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					



表 1-38 固定污染源废气检测结果表（8 月 6 日）

点位名称		FQ-005 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		24.3	24.4	24.4	24.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		12287	12394	12410	12364	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-39 固定污染源废气检测结果表（8 月 6 日）

点位名称		FQ-006 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		24.2	24.2	24.3	24.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		12042	12197	12196	12145	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-40 固定污染源废气检测结果表（8 月 6 日）

点位名称		FQ-011 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		24.3	24.4	24.5	24.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		12048	12134	12328	12170	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》（HJ/T 67-2001）
氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016）
硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》（HJ 544-2016）
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）
氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》（HJ/T 30-1999）
氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）
硫化氢	《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ 1388-2024）
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
备注	/

表 3 仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
F-001-14	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
X-016-35	全自动烟气采样器	MH3001
F-010-06	离子色谱仪	883
X-015-76	烟气综合分析仪	崂应 3022
X-015-74	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
F-014-22	离子计	PXSJ-216
X-015-73	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-015-79	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-015-78	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-015-77	烟气综合分析仪	崂应 3022
X-046-09	数字温度表	6801
X-015-105	阻容法烟气含湿量多功能检测器	1062D 型
X-016-40	全自动烟气采样器	MH3001
X-060-50	充电便携采气桶	labtm009
F-010-19	离子色谱仪	ECO IC
X-016-41	全自动烟气采样器	MH3001
F-001-13	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
X-016-43	全自动烟气采样器	MH3001

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*